ＳＰ部会賞候補業績応募要領

公益社団法人日本表面真空学会ＳＰ部会

本賞は、スパッタリングおよびプラズマプロセス技術およびその関連分野の発展に寄与するために、この分野の顕著な業績を「ＳＰ部会賞内規」にしたがって表彰するものです。

ＳＰ部会賞候補に推薦され、また応募された業績に対して行いますので、自薦他薦とも下記要領によりご応募ください。

1. 提出書類： 候補業績名、推薦理由または応募理由、推薦者名または応募者名を記したＡ４の書類（書式任意）。参考となる論文、パンフレットなどを添付する。郵送か、PDF 化したものをメール添付で送付。
2. 提出先： 公益社団法人日本表面真空学会事務局　ＳＰ部会担当
   〒113-0033　東京都文京区本郷 5-25-16　石川ビル 5 階
   E-mail: office@jvss.jp　　TEL 03-3812-0266
3. 表彰対象者など： 候補者は原則として、ＳＰ部会法人部会員および法人会員所属組織員とする。また、推薦者または応募者は、原則として、ＳＰ部会個人会員、法人会員および法人会員所属組織員とする。
4. 提出期限：2026 年 11 月 30 日(月)

ＳＰ部会賞内規

（目的）

第 1 条　この内規は、スパッタリングおよびプラズマプロセス技術およびその関連分野の顕著な業績を表彰する「ＳＰ部会賞」の表彰について定める。

（表彰対象有資格者）

第 2 条　表彰対象者は、原則として、スパッタリングおよびプラズマプロセス技術（SP）部会法人部会員および法人部会員所属組織員とする。

（推薦資格）

第 3 条　推薦資格者は原則として本部会の個人部会員，法人部会員および法人部会員所属組織員とする。

（表彰の対象となる製品、技術）

第 4 条　賞の対象は、表彰を行う年の前年の 12 月 31 日までに公知となっている優れた製品、開発された新技術などとする。

（表彰の対象となる者）

第 5 条　表彰は、第４条に該当する業績をあげた個人または団体に対する賞状および副賞贈呈をもって行う。賞状は、共同研究、共同開発の場合には、関係者全員に贈り、団体の場合にはその代表者１名に贈る。副賞は原則盾とし、共同研究、共同開発の場合には代表者１名に贈る。

（表彰件数の上限）

第 6 条　表彰件数は原則として毎年 2 件以内とする。

（表彰の方法）

第 7 条　表彰は部会定例研究会で部会長がおこなう。

（表彰審査委員会）

第 8 条　表彰の受賞業績を選考するため、表彰審査委員会を設ける。

（受賞候補の推薦）

第 9 条　表彰審査委員会は受賞候補を決定し、意見とともに幹事会に提出する。

（受賞対象の決定）

第 10 条　幹事会は前条により提出された受賞業績候補について審議の上、受賞業績ならびに受賞者を決定する。

（内規の改廃）

第 11 条　この内規の改廃は理事会の議決をもって行うものとする。

付記

この規程は 2019 年 7 月 20 日より施行する。